

NEW FROM



STACIS® ix SEM-Base® VI

用于SEM的主动式压电陶瓷振动消除地面式平台

SEM-Base® VI 优势

硬式装载技术

SEM-Base VI兼容SEM内部预装的任何隔振系统，从0.6Hz开始主动强力消减地面低频振动。

主动惯性振动消除

SEM-Base VI采用高灵敏度的低频惯性速度传感器，即使在安静的地面上也可以达到高水平的振动衰减。

串行设计与压电技术

独特串行设计加上高强度压电专利技术，SEM-Base VI不但达到了宽至0.6Hz-150Hz的主动带宽，更实现了无与伦比的惯性主动振动消除，2Hz以上的振动衰减可达90%以上。

完全集成式的单平台设计

SEM-Base VI设计与制造的集成化，将安装平台的工作简化到了极致，简单的定位与设置之后即可正常工作。

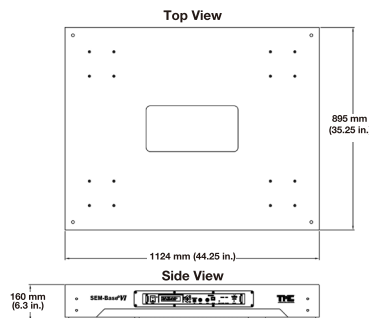
NOTE: 可选SEM-Closure，专门设计用于保护SEM的完整环境解决方案。在SEM-Closure密封隔音室内可兼容放置SEM-Base VI与Mag-NetX，保护SEM免除振动、磁场扰动与声波噪音的影响。



SEM-Base VI是TMC STACIS主动压电振动消除产品系列的新一代产品。SEM-Base VI设计用于承载所有商业扫描电子显微镜 (SEMs)、多数聚焦离子束显微镜 (FIB) 及小型双光束设备。SEM-Base VI可以提供升级版的振动隔离性能及更快更强劲的控制，带有高级图形用户界面 (GUI)。SEM-Base VI让越来越多的实验室、工厂可以实现能够满足其关键设备所要求的地面振动水平。

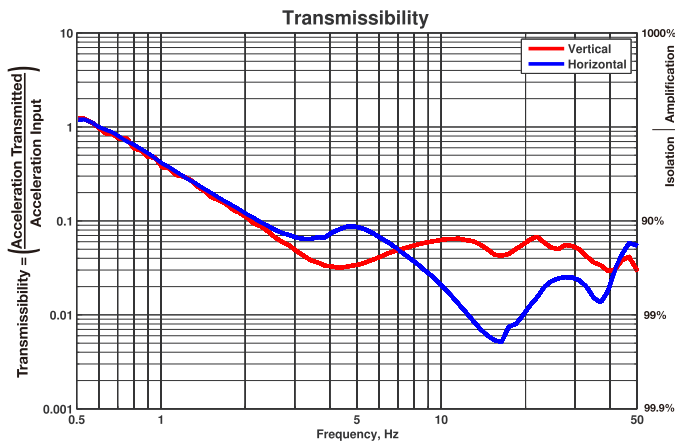
SEM-Base VI采用独特串联结构，振动传感器测量的是地面振动，不是负载振动。这样就确保了负载谐振将不会限制平台的振动隔离或者引起不稳定性。振动传感器采用低频惯性速度传感器，在测量亚Hz振动时具有最大的灵敏度。加上TMC独特的压电致动技术，SEM-Base VI即使在振动情况已经很好的地面上也可以实现超高水平的振动消除。

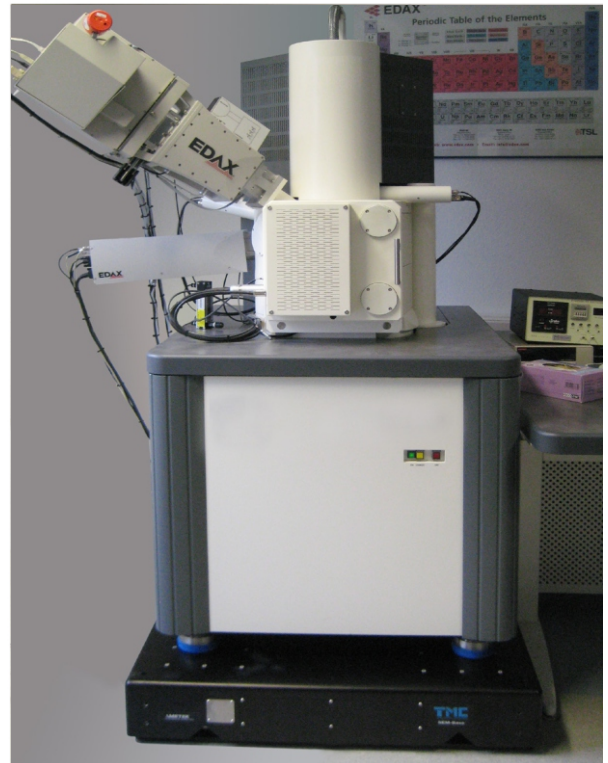
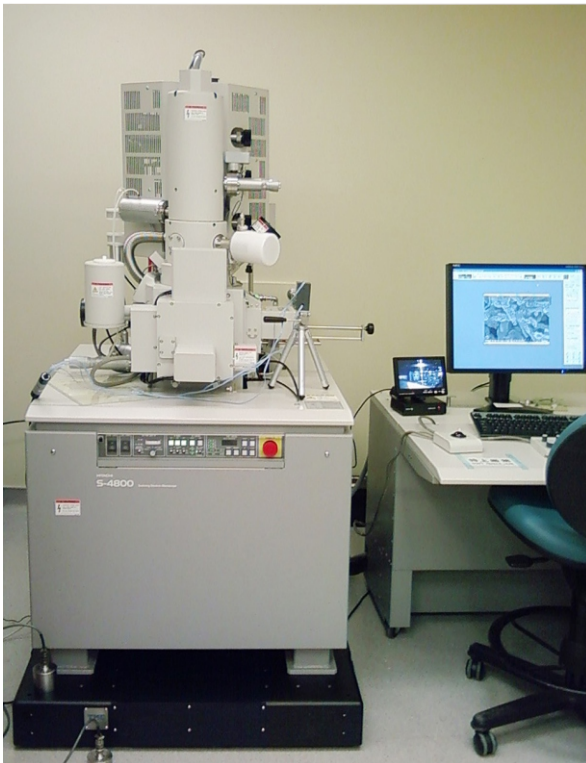
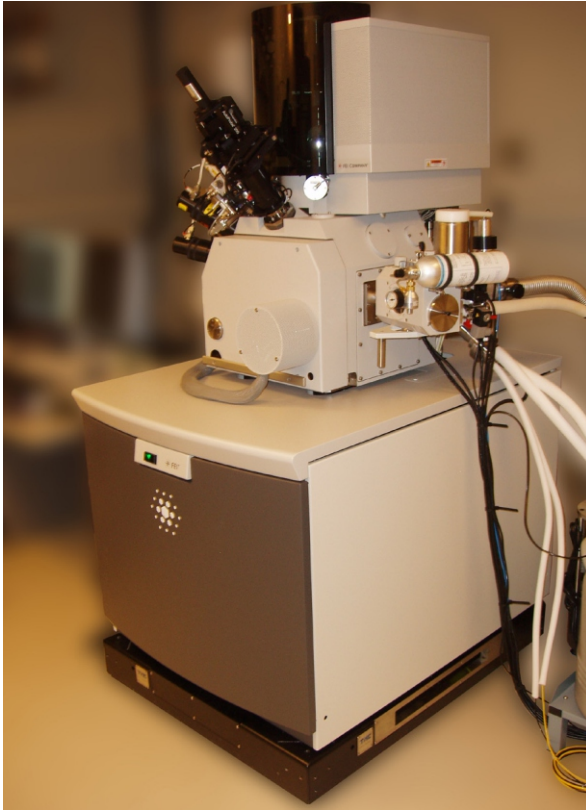
相比于之前的SEM-Base版本，SEM-Base VI的振动隔离能力平均来说增加了6dB，而且采用了TMC新一代控制器DC-2020，采用新式双核处理器，为设备拥有者及研究者提供非常简单易于使用的图形用户界面，可以快速进入系统并实现平和的操作心态。当通过Ethernet连接时，DC-2020在用户的浏览器上即可实现SEM-Base图形用户界面，无需额外安装软件或者应用程序。当然用户也可以通过控制器的板载式菜单驱动液晶屏 (LCD) 直接进行控制。



特色

- STACIS专利技术
- 主动惯性振动消除系统
- 895×1124×160 mm (35.25×44.25×6.3 in.) 适合绝大多数商业SEMs
- 负载能力: 408-1134 kg (900-2500 lb.)
- 隔振效率1Hz: 40-70%
- 隔振效率2Hz: 90%
- 隔振效率>3Hz: 90-98%
- 6个主动自由度
- 安装容易，调谐简单
- 兼容所有设备内置的振动隔离系统
- 电源: 100-240VAC, 50/60Hz, <600W
- 是否需要空气: 非气浮系统
- CE与RoHS认证
- 完全集成式的单平台设计
- 可安装脚轮，轻松便携移动，无需搬运
- 兼容SEM-Lift系统





STACIS[®] ix SEM-Base[®] Floor Platform isolating an FEI Helios NanoLab DualBeam SEM/FIB (top left), a JEOL JSM-7800F Field Emission Scanning Electron Microscope (top right), an Hitachi S-4800 SEM (bottom left), and a SEM with EDAX TEXS WDS Spectrometer and EDAX Hikari EBSD Camera (bottom right).